

2026年度ナノプロセシング施設 (NPF) 単価表

2026年4月1日改訂

装置番号	装置名称	設置場所	装置分類	トレーニング カテゴリ	備考(注1)	利用報告書提出& データ提供			利用報告書提出			利用報告書非提出(注4) & データ提供			利用報告書非提出(注4)		
						機器利用	技術補助	技術代行 (注3)	機器利用	技術補助	技術代行 (注3)	機器利用	技術補助	技術代行 (注3)	機器利用	技術補助	技術代行 (注3)
NPF003	イオンコーター (FIB付帯) (2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF004	電界放出形走査電子顕微鏡[S4800_FE-SEM]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	8,000	20,000	22,000	11,200	28,000	30,800	16,000	40,000	44,000	22,400	56,000	61,600
NPF006	マスクレス露光装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィー	2	有償トレーニング	10,400	20,400	23,400	14,500	28,500	32,700	29,000	49,000	55,000	40,600	68,600	77,000
NPF008	スピノコーター(フォト)	CR2 イエロールーム	リソグラフィー	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF009	コンタクトマスクアライナー[MJB4]	CR2 イエロールーム	リソグラフィー	2	有償トレーニング	2,600	12,600	15,600	3,600	17,600	21,800	6,400	26,400	32,400	8,900	36,900	45,300
NPF010	反転露光用全面UV照射装置	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー	1	有償トレーニング	500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF011	線露光装置	CR3 イエロールーム	リソグラフィー	3	技術代行専用	19,500	31,500	33,500	27,300	44,100	46,900	52,000	76,000	80,000	72,800	106,400	112,000
NPF012	有機ドラフトチャンバー_右(フォト)(注5)	CR2 イエロールーム	リソグラフィー	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF013	有機ドラフトチャンバー_左(フォト)(注5)	CR2 イエロールーム	リソグラフィー	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF014	有機ドラフトチャンバー_右(EB)(注6)	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF015	酸アルカリドラフトチャンバー_右	CR1 クリーンルーム	表面処理	0		500	12,500	14,500	500	12,500	14,500	6,200	30,200	34,200	7,700	30,200	34,200
NPF016	スターラーウォーターバス[SWB-10L-1]	CR1 クリーンルーム	表面処理	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF017	スマートウォーターバス[TB-1N](フォト)	CR2 イエロールーム	リソグラフィー	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF018	反応性イオンエッチング装置 (RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング	2	有償トレーニング	4,000	14,000	17,000	5,600	19,600	23,800	10,400	30,400	36,400	14,500	42,500	50,900
NPF019	多目的エッチング装置 (ICP-RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング	2	有償トレーニング	10,400	20,400	23,400	14,500	28,500	32,700	29,000	49,000	55,000	40,600	68,600	77,000
NPF021	プラズマアッシャー	CR5 クリーンルーム	表面処理	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF022	UVオゾンクリーナー	CR5 クリーンルーム	表面処理	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF023	電子ビーム真空蒸着装置	CR1 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	9,000	19,000	22,000	12,600	26,600	30,800	19,000	39,000	45,000	26,600	54,600	63,000
NPF024	抵抗加熱型真空蒸着装置	CR1 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	5,000	15,000	18,000	7,000	21,000	25,200	10,000	30,000	36,000	14,000	42,000	50,400
NPF025	スパッタ成膜装置(芝浦)	CR1 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	6,000	16,000	19,000	8,400	22,400	26,600	12,000	32,000	38,000	16,800	44,800	53,200
NPF029	メッキ装置	CR1 クリーンルーム	成膜	3	有償トレーニング	2,600	14,600	16,600	3,600	20,400	23,200	8,000	32,000	36,000	11,200	44,800	50,400
NPF030	プラズマCVD薄膜堆積装置	CR5 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	4,600	14,600	17,600	6,400	20,400	24,600	16,000	36,000	42,000	22,400	50,400	58,800
NPF031	原子層堆積装置_1[FlexAL]	CR5 クリーンルーム	成膜	2	技術代行専用	8,000	18,000	21,000	11,200	25,200	29,400	19,200	39,200	45,200	26,800	54,800	63,200
NPF032	クロスセクションポリッシャー(ALD付帯)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	4,000	14,000	17,000	5,600	19,600	23,800	9,600	29,600	35,600	13,400	41,400	49,800
NPF033	アルゴミリング装置	CR1 クリーンルーム	エッチング	2	有償トレーニング	4,000	14,000	17,000	5,600	19,600	23,800	9,600	29,600	35,600	13,400	41,400	49,800
NPF034	集束イオンビーム加工観察装置 (FIB)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3	技術代行専用	13,000	25,000	27,000	18,200	35,000	37,800	29,000	53,000	57,000	40,600	74,200	79,800
NPF035	イオンコーター (SEM付帯) (2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF038	二次イオン質量分析装置 (D-SIMS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	技術代行専用	9,100	19,100	22,100	12,700	24,600	28,100	25,000	45,000	51,000	35,000	59,500	65,100
NPF039	オゾンクリーナー (SIMS付属)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF041	ウェハー酸化炉	CR1 クリーンルーム	熱処理	1	有償トレーニング	2,000	11,000	13,000	2,800	15,400	18,200	6,400	24,400	28,400	8,900	34,100	39,700
NPF044	マッフル炉	CR1 クリーンルーム	熱処理	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF045	触針式段差計	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF046	走査プローブ顕微鏡SPM_1[NanoscopeIV /Dimension3100](注8)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	4,000	16,000	18,000	5,600	22,400	25,200	10,400	34,400	38,400	14,500	48,100	53,700
NPF047	走査プローブ顕微鏡SPM_2[SPM-9600/9700](注8)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	4,000	16,000	18,000	5,600	22,400	25,200	10,400	34,400	38,400	14,500	48,100	53,700
NPF048	ナノサーチ顕微鏡SPM_3[SFT-3500](注8)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	5,200	17,200	19,200	7,200	24,000	26,800	13,000	37,000	41,000	18,200	51,800	57,400
NPF049	ナノプローバ[N-6000SS]	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3	技術代行専用	10,400	22,400	24,400	14,500	31,300	34,100	22,400	46,400	50,400	31,300	64,900	70,500
NPF050	四探針プローブ抵抗測定装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	0		500	9,500	11,500	700	13,300	16,100	4,000	22,000	26,000	5,600	30,800	36,400
NPF051	デバイスパラメータ評価装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2,600	12,600	15,600	3,600	17,600	21,800	6,400	26,400	32,400	8,900	36,900	45,300
NPF052	デバイス容量評価装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2,600	12,600	15,600	3,600	17,600	21,800	5,600	25,600	31,600	7,800	35,800	44,200
NPF053	ワイヤボンダー (2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2,600	12,600	15,600	3,600	17,600	21,800	6,400	26,400	32,400	8,900	36,900	45,300
NPF054	ダイシングソー	CR4 クリーンルーム	その他	3	有償トレーニング	4,600	16,600	18,600	6,400	23,200	26,000	13,000	37,000	41,000	18,200	51,800	57,400
NPF055	スクライバー	CR4 クリーンルーム															